

Základy technologie výroby polovodičů

PřF MU, Kotlářská 2, Brno, učebna Fs1 12:00-14:50

Datum	Přednášející	Téma
18/9/23	Pánek	Přehled technologie výroby Si desek
25/9/23	Šik	Přehled technologie výroby SiC krystalů a desek
2/10/23	Špetík, R.	Přehled postupu návrhu a výroby integrovaných obvodů
9/10/23	Válek	Růst monokrystalů křemíku
16/10/23	Pánek	Čištění povrchu křemíku a karbidu křemíku
23/10/23	Plachký	Analýza povrchů ve výrobě polovodičů
30/10/23	Kocián	Technologie výroby struktur Silicon-On-Insulator
6/11/23	Špetík, Z.	Oxidace Si desek a difuze příměsí
13/11/23	Lysáček / Špetík, Z.	Chemické depozice vrstev z plynné fáze – základní principy
20/11/23	Lysáček / Špetík, Z.	Technologie chemických depozic vrstev z plynné fáze
27/11/23	Špetík, R.	Fotolitografie vrstev, leptání SiO ₂
4/12/23	Špetík, Z.	Plazmochemické leptání vrstev, depozice kovových vrstev
11/12/23	Pánek	Aplikace statistických metod v průmyslu
18/12/23	Pánek	kolokvium